

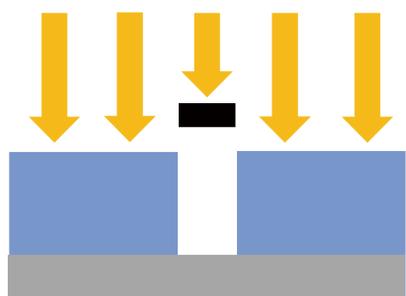
## 富士フィルムの「環境対応」について紹介

当社は環境対応の一環として、PFASフリー化と溶剤リサイクルの両面に取り組んでいます。PFASフリー化は有害物質の排出抑制に寄与し、一方の溶剤リサイクルは資源とエネルギーの節約や廃棄物削減に効果的です。これらの活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献し、半導体業界におけるサステナビリティ向上に積極的に関与しています。

### PFASフリーの取り組み

- PFAS を一切使わずに微細な回路形成と欠陥を抑制したネガ型の ArF 液浸レジストを開発。
- 当社の機能性分子技術を駆使し、優れた反応効率や高い撥水性を実現した。

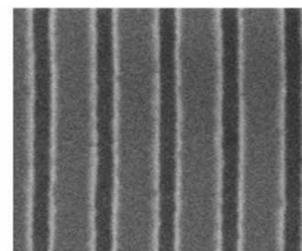
ネガ型のArF液浸レジスト



ネガ型レジスト

金属配線工程では抜きパターンが必要とされ、高い解像性を実現するネガ型レジストの需要が増加

良好な解像度



有機溶剤  
現像液

+



### 溶剤リサイクルの提案

- これまで廃却あるいは低グレード品へ再利用されていた使用済み溶剤を回収し、精製蒸留することで半導体用途での再利用に繋げる。
- 精製蒸留を経た高品質なリサイクル溶剤を使用し、半導体材料を製造。新規合成品と変わらぬ性能の実現を目指す。

